

ICS 27.120

F51

备案号:

# 团 体 标 准

T/CIRA 12—2020

## 工业仪表用氪 85 测厚源

Krypton 85 Thickness Measurement Source For Industrial Gauging

(报批稿)

2020 - 12 - 28 发布

2021 - 3 - 1 实施

中国同位素与辐射行业协会 发布

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 产品代码、规格及结构 .....	2
5 技术要求 .....	2
6 检验方法 .....	3
7 检验规则 .....	3
8 产品标志、包装、贮存和运输 .....	4
附录 A（资料性附录） 氦 85 测厚源产品规格 .....	5
附录 B（资料性附录） 产品材质及结构 .....	6
附录 C（资料性附录） 产品证书格式 .....	8

## 前 言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国同位素与辐射行业协会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：原子高科股份有限公司、中国同辐股份有限公司、生态环境部核与辐射安全中心。

本文件主要起草人：梁斌斌、张轶名、王晓涛、徐卓、朱玉、王寅宁、彭怡刚。

本文件的附录A、附录B和附录C均为资料性附录。